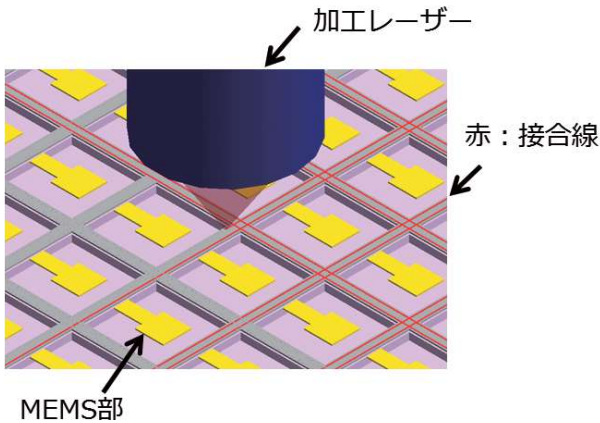


レーザーによる MEMS 用ウエハ接合の技術開発



目指したもの

レーザー接合装置を開発するに当たり、対象となる MEMS を想定したサンプルを大阪産業技術研究所にて製作し、接合の評価を行う。

課題

- 接合のシール性の評価
- 接合に必要な膜の形成

大阪技術研の支援内容

- 薄膜の作製
- フォトマスクレイアウトの提案
- MEMS微細加工

●支援メニュー

- 技術相談
- 装置使用
- 依頼試験
- 受託研究

企業名	タツモ株式会社
所在地	岡山市北区芳賀5311
URL	https://www.tazmo.co.jp/
事業内容	半導体製造装置、各種ロボット、液晶製造装置、精密金型・樹脂成型品などの開発・製造・販売

異物検査システム

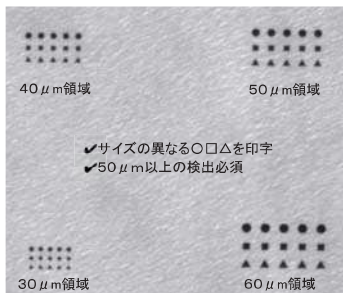


図 校正基板

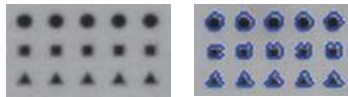


図 画像解析結果(拡大)

目指したもの

洗浄済み加工部品の清浄度管理 (50 μ m 以上) が求められている。表面に付着した異物を溶媒抽出によりメンブレンフィルターに捕捉し、サイズ及び個数を測定可能な装置を開発したい。

課題

- 画像処理ソフトの開発
- 光学及び機構設計
- 校正手段の確立

大阪技術研の支援内容

- メタルフォトマスクのレイアウト提案
- メタルフォトマスクの作製

特許など

異物測定方法、異物測定装置および校正基板
特許7495168

●支援メニュー

- 技術相談
- 依頼試験

企業名	アクア化学株式会社
所在地	大阪府和泉市テクノステージ3丁目7-24
URL	https://aqua-c.com/
事業内容	・加工油・洗浄剤・防錆剤の開発及び製造 ・産業用洗浄装置の開発及び製造 ・測定機器の開発及び製造